南京大學

III族氮化物半导体异质结构材料 面临的若干科学技术问题

郑有炓 南京大学 2010.10.14



报告内容:

- 一、III族氮化物异质结构是III族氮化物
 技术的核心
- 二、 III族氮化物异质结构材料面临的 几个科学技术问题
- 三、 结束语



报告内容:

- 一、III族氮化物异质结构是III族氮化物
 技术的核心
- 二、III族氮化物异质结构材料面临的 几个科学技术问题
- 三、 结束语



III族氮化物半导体包括氮化铟(InN),氮化镓(GaN), 氮化铝(AIN)及其合金半导体材料。



Ⅲ族氮化物半导体材料特点?

4



1, 宽广能隙

能隙: 0.7-6.2 eV 复盖Ge、Si、GaAs、InP 等传统材料能隙范围

光学窗口: 1.77μm — 0.36μm – 0.20μm









闪锌矿GaN的能带



纤锌矿InN的能带结构

纤锌矿AIN的能带结构





III 族氮化物是由电负性较强的N原子与电负性较弱的In、Ga、AI原子构成的一种具有很强电荷转移的离子型纤锌矿结构晶体。





Ga-face



冬

理想纤锌矿晶格常数比值 *c*₀/*a*₀=1.633

Ⅲ族氮化物晶格常数比较小 GaN(1.627), InN(1.623) AIN(1.601)

◆ 自发极化系数(C/cm²)
 GaN (- 0.029), InN (- 0.032),
 AIN (- 0.081)

自发极化系数很大,AIN只比典型的钙钛矿 结构铁电体小3-5倍。





尚无可实用的氮化镓单晶 熔点高(2500 O C),蒸气压高(4.5 GPa)。

大失配异质外延 蓝宝石作为衬底 GaN与蓝宝石的晶格失配16%,

极强的压电极化



5,极强压电极化

◆ 纤锌矿晶体结构在[0001]方向不具有反 演对称性,(0001)面上的应力展现压电极化 效应.





压电矢量P_{PE}由压电系数e和应变张量*ε*乘积 决定。

$$P_{\rm PE} = 2(1-R)\frac{a-a_0}{a_0} \left(e_{31} - e_{33}\frac{C_{13}}{C_{33}}\right)$$

张应变(*a* >*a*0)时压电极化为负,平行于自 发极化 压应变(*a* <*a*0)时压电极化反平行于自发极 化



6, 极化感生两维电子气 (2DEG)







2DEG 密度高达10¹³cm⁻², 比AIGaAs/GaAs高 出4到5倍



 化学比偏离,p型杂质激活能高,就必须
 掺入大量杂质,方能得到足够的载流子浓度, 但又降低了载流子迁移率。
 制约了同质结器件的发展,必需采用异制
 结构。

♦ Ⅲ族氮化物异质结构是当前光、电技术的 基本结构。



小结

Ⅲ族氮化物与传统的半导体不同,是一种具有很强压电、铁电性的宽广带隙、直接能隙半导体,具有丰富的科学技术内涵;

2, III族氮化物异质结构是III族氮化物技术 应用的基本途径 和科学技术基础;

3, III族氮化物异质结构材料对III族氮化物 技术发展起着决定性作用。





一、III族氮化物异质结构是III族氮化物
 技术的核心

二、 III族氮化物异质结构材料面临的 几个科学技术问题

三、 结束语





一、III族氮化物异质结构是III族氮化物
 技术的核心

二、 III族氮化物异质结构材料面临的 几个科学技术问题

三、 结束语

III族氮化物异质结构独特的光、电性质展现极其广阔的技术应用前景。

当前两大技术领域:

基于宽广直接带隙的高效光电转换行为 光发射器件(LED,LD) LED 照明技术 光探器件(日光盲紫光探测) "太阳辐射盲区", 230-280nm Ⅱ 基于极化感生二维电子气行为 高电子迁移率微波功率器件(HEMT) HEMT 传感器件















微波功率HEMT技术



AIGaN/GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT)



短短的10多年来,以LED和HEMT为代表的III族氮化物异质结构技术高速发展,不仅在现代高技术领域中确立了重要地位,而且已经形成战略型新兴产业,展现巨大的发展空间,对社会经济、技术的发展起着重要的推动作用。



LED 照明作为一种节能、绿色、智能照 明技术,已经在各个领域广泛应用,作 为当代节能减碳战略性新兴产业在全球 迅猛崛起,LED照明产业蓬勃发展,展 现巨大的发展空间。

2009年我国半导体照明产值达600亿元

◆ LED 照明产业正步入"快速成长期"







机遇与 挑战并存

基于C面蓝宝石衬底上生长的GaN基异质结构在LED照明和HEMT功率微波器件应用上业已经取辉煌成就,但也遇到一些关键科学技术问题,对技术发展起了制约作用。



高驱动电流下LED光效下降 (Efficiency Droop)

InGaN LED在工作电流密度超过10-70A/cm², 器件的外量子效率开始急剧下降,这种现象被称为 "Efficiency Droop"。





♦ "Efficiency Droop"成为制约功率LED 固态照明发展的技术"瓶颈"。

♦ 降低、抑制LED Efficiency Droop成为 当前进一步发展功率LED 照明的关键问题。





☞ 目前量产的小功率LED芯片光效140-150lm/W,离理想值还有很大的提升空间。

■ 理想值,超过300 lm/W

■ 依据黑体辐射的理论,光通量(流明) 与辐射通量关系,Km = 683 lm/W,因此, 对理想情况,1W的辐射通量可能产生683 lm/W 的光通量。



长波段、短波段LED光效低



♦ Ⅲ族氮化物全组份直接带隙半导体材料 ♦ 带隙能量(0.7eV-6.2eV)复盖红外到紫外宽广波段 ◆ 可用于制备 红、绿、蓝LED 发光器件



III族氮化物LED发光效率波长响应谱



✦ LED发光效率波长响应谱呈"马鞍形"。发光效率峰值在蓝 光波段,短波段急剧下降,长波段也呈下降趋势。

🔶 紫光、绿光、黄光、红光效率低。







以上所述目前III族氮化物光电技 术发展中面临的问题,都与 III族 氮化物异质结构特性密切相关。



1, Ⅲ族氮化物异质结构表面态







电子从表面态迁移至量子阱中形成二维电子气



不同于GaAs材料,GaN基异质结构不存 在费米能级钉扎现象,HEMT结构的2DEG 很容易受表面环境引起的电势调制。



35



电流崩塌 (Current collapse)



36


电流崩塌物理机制—虚栅模型 表面电子陷阱态充放电迟豫过程





(b)

Drain



反之,基于HEM结构2DEG对外界的敏感性,可用于发展各种2DEG传感器。



HEMT-2DEG传感结构



未掺杂的功能结构

极化效应感生高浓度2DEG(极化掺杂)

Open-gate M 面作为传感窗口

耐高温、抗腐蚀、抗高能粒子轰击提供稳定、可靠反应室 39



根据极化HEMT结构2DEG的物理机制, M面电荷的任何改变增加或减少,通过 补偿或AlGaN势垒层中电场放大,将使 界面2DEG浓度相应增加或减少。因此. 可用来探测气体,离子,生物分子和溶 液PH值。

南京大學 (P102)



极性液体探测



direct monitoring of cell activity (action potential)





covalent bonding of biomolecules

- through Au-thiol chemistry
- directly on (modified) AlGaN surface



生物传感器





蛋白质探测器



AIGaN/GaN HEMT 紫外探测器



晶体管器件结构剖面图(a)与顶视图(b)

陈辰等人, CPL,24(9)2007



HEMT直流特性





增益与频率关系曲线

截止频率19GHz, 最大振荡频率35GHz。



■在333nm处出现一峰值,与Al_{0.15}Ga_{0.85}N的带隙对应。



如何调控III族氮化物异质结构表面态?

--- 表面钝化

---- 应变调控

----- 极化场调控









使电子、空穴沿阱的不同界面分离
 从而降低电子、空穴波函数的交叠



3, 注入电荷对极化场QCSE的屏蔽作用

发光波长蓝移



驱动电流对LED发光波长的调制



如何调控极化效应?





● 低铟组份InGaN/GaN体系
 两者自发极化系数相近, △P_{sp}≈ 0
 晶格失配不大,存在压电极化, P_{PE}
 但QCSE作用弱

 QCSE对器件性能影响不大 蓝光LED发光效率高 发光波长没有明显红移 发光波长随注入电流增大没有明显蓝移





◆ 低铟组份InGaN/GaN体系 两者自发极化系数相近, $\Delta P_{sp} \approx 0$ 晶格失配大,较强的压电极化, P_P QCSE作用强 ♦ QCSE对器件性能影响较大 绿光LED发光效率低 发光波长有明显红移 发光波长随注入电流增大有明显蓝移





♦ 高AI组份AIGaN/GaN体系 两者自发极化系数相差3倍, $\triangle P_{so}$ 很大 晶格失配很大,很强压电极化, P_P QCSE作用很强 ♦ QCSE对器件性能影响较大 紫光LED发光效率很低 发光波长有明显红移 发光波长随注入电流增大有明显蓝移



利用极化场的"量子限制斯塔克效应对 源区电子态的调制,提高少子寿命,优 化器件性能。









GaN基紫外光电探测器

	Al _{0.2} Ga _{0.8} N (15nm)
GaN	GaN (60)
(600)	Al _{0.2} Ga _{0.8} N (15)
	GaN (500)
AIN buffer (150)	AIN buffer (150)
sapphire	sapphire
substrate	substrate

(a) monolayer (b

(b) multilayer



AIN/GaN紫外光电探测器



AIN/GaN探测器 峰值响应度高达27500A/W(3V,358nm) GaN探测器 峰值响应度330A/W(3V,360nm), 前者相比高83 倍。

六方结构III族氮化物晶面



◆ c面为极性面 ◆ a面、m面为非极性面 ◆ r面为半极性面

六方结构III族氮化物晶面





LiAIO₂上生长的M面InGaN/GaN异质结LED









◆ 大失配异质外延 GaN与蓝宝石的晶格失配达16% ◆ 缺陷密度高达10⁸- 10¹¹/cm²





◆ Ⅲ族氮化物InGaN/GaN LED 器件失配位 错高达10⁸-10⁹/cm²,为什么还能高效发光?

◆ 为什么Ⅲ族氮化物缺陷对光学性质的影响 不像Ⅲ族砷化物、Ⅲ族磷化物那样明显?





- 位错电激活性非常小,空穴扩散长度很小
- 载流子带边局域化效应扼制了缺陷对载流子非辐射
 复合行为,导致LED高效发光。
- 大注入下**载流子积累退边局域化效应,使效率下降** 64



大注入条件下, $In_xGa_{1-x}N/GaN$ 量子阱电子、 空穴通过缺陷的非辐射复合过程





高驱动电流工作时LED"量子效率下降" (Efficiency Droop)的问题





◆Al_xGa_{1-x}N体系材料,一般认为不存在局域 化效应,而且高AI组分 Al_xGa_{1-x}N与GaN之间 的晶格失配和热失配都比In_xGa_{1-x}N/GaN体系 材料大得多,因而高缺陷密度是高AI组分 Al_xGa_{1-x}N外延材料最突出的问题。



Al_xGa_{1-x}N材料中的穿通位错和点缺陷起着 非辐射复合中心作用,强烈影响其发光性能, 将明显降低绿光、UV光发射效率。



68

南京大學

◆弄清缺陷对Al_xGa_{1-x}N材料的发光性能的影响以及如何降低高Al组分 Al_xGa_{1-x}N材料的缺陷密度是发展绿光和深紫外LED器件的至关重要的问题。



◆ AI空位(V_{AI})是AIGaN 材料中最典型的缺陷,它是在材料外延生长中产生的。

 ◆ 对于高AI组分AIGaN材料, AI空位的形成 能随AI组分增加而减小,因而,外延生长期间
 AI空位很容易形成,并且与0杂质的结合形成
 了0-V_{AI}络合体。



◆ 高AI组分AIGaN材料中高浓度0和V_{AL}的存在,使材料成为高电阻率。 因此,由于杂质、缺陷互作用使高AI组分 AI_xGa_{1-x}N材料常呈现低电导特性,甚至成为半绝缘性质。

eg. 非故意掺杂AIN 成为半绝缘性质。



在AlxGa1-xN材料中施主、受主杂质 激活能随Al组分增加而增大:

 AI的含量每增加1%,受主杂质(Mg)的激活能 增大3meV。施主(Si)激活能增大5.23meV
 eg. AI_{0.7}Ga_{0.3} N 为23meV; AIN为180meV

◆ AI组分每增加8%,电阻率将增大1个量级, 高AI组分AIxGa1-xN材料很难得到高电 导率的N型和P型材料。


降低缺陷密度—异质外延---准异质外延----同质外延 ↑ ↑ ↑ <u>©变能带工程</u>同质模板 单晶衬底

极化调控

大芯片技术

六方结构III族氮化物晶面



◆ c面为极性面 ◆ a面、m面为非极性面 ◆ r面为半极性面



发展LED 芯片规模量产技术

面对产业正步入快速成长期,一方面对芯片
 需求量越来越大,另方面降低芯片制造成本日益
 重要。因此,提高产能,降低成本成为技术发展
 的当务之急。

◆如何提高产能,降低成本?基于芯片工艺技术与硅微电子芯片的相似性,可以借鉴、吸取硅微电子芯片的发展经验。



◆ 增大硅片直径是提高产能,降低 成本的有效手段。



硅片大直径化历程



因此,为提高LED照明芯片产能,降低成本必须实行"从多片小尺寸外延生长朝向大尺寸外延"的生产技术路线。这样,可有效提高每次外延生长周期的可用芯片面积。

◆ 据AIXTRON 公司分析(AIX G5型MOCVD)
 (1) 42x2"/次,总面积为851cm²,可用面积为
 662cm²;

(2) 6x6"/次,总面积为1094cm²,可用面积为 1009cm²;比(1)提高52.63%



发展LED 芯片规模量产技术涉及: ■ 大尺寸芯片 MOCVD外延设备

■ 大尺寸外延衬底材料选择与制备

■ 大尺寸芯片MOCVD外延技术

■ 大尺寸LED芯片器件工艺生产线



报告内容:

- 一、III族氮化物异质结构是III族氮化物
 技术的核心
- 二、III族氮化物异质结构材料面临的 几个科学技术问题

三、 结束语



机遇不断, 挑战不停, 满怀信心, 空间巨大, 任重道远, 前途无限!









2010.10.14